Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Смирнов Сергей Николаевич Научно-исследовательская база

Должность: врио ректора наименование направления подготовки: 03.06.01 Физика и астрономия Дата подписания: 06.09.2024 15:08:18 уник Колдин наименование научной специальности: 1.3.8 Физика конденсированного состояния

69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08

Лаборатории:

- 1. Учебно-исследовательская лаборатория «Твердотельной электроники»;
- 2. Научно-исследовательская лаборатория электронной микроскопии (НИЛЭМ) ЦКП ТвГУ;
- 3. Учебно-научная лаборатория радиоэлектроники и микроэлектроники;
- 4. Межвузовская научно-исследовательская лаборатория наукоемких технологий и приборов;
- 5. Учебно-научная лаборатория оптических измерений;
- 6. Учебно-научная лаборатория оптической микроскопии;
- 7. Учебно-научная лаборатория сканирующей зондовой микроскопии;
- 8. Научно-исследовательская лаборатория кристаллизации ЦКП ТвГУ

Оборулование:

Оборудов	
	Научно-исследовательская лаборатория электронной микроскопии (НИЛЭМ) ЦКП ТвГУ № 25 корпус 3
	Программно-аппаратный комплекс для микроанализа и морфологического анализа
1.	поверхности (растровый электронный микроскоп JSM-6610LV). Аналитическая приставка к
	PЭM Oxford INCA Energy 350 (Система рентгеновского энергодисперсионного микроанализа).
2.	Установка магнетронного распыления JEOL JFC-1600
3.	Установка вакуумного напыления ЈЕЕ 420Т
	Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи с многофункциональным
4.	программным обеспечением ZetLab
	Интерферометр высокого разрешения, сканирующий в белом свете NanoMap
5.	1000WLI (SEAP TECHNOLOGY)
6.	Автоматический трехкружный рентгеновский дифрактометр ДСО-2B2 (DSO-2V2)
7.	Лазеры ЛГИ-118-3В, ЛГИ-118-3ВИП; спектрофотометр ИКС-29 (Ломо)
	Учебно-научная лаборатория оптических измерений № 218а корпус 3
8.	Микроскоп цифровой тринокулярный Levenhuk D670T
9.	Поляризационный микроскоп МИН-4
10.	Металлографический микроскоп Photoplan
11.	Поляризационный микроскоп проходящего и отраженного света ПЛМ-2
	Учебно-научная лаборатория оптической микроскопии №38 корпус 3
12.	Большой фотомикроскоп отраженного света NEOPHOT-30
13.	Инвертированный микроскоп отраженного света с опцией устройства проходящего света Axiovert 200 MAT
14.	Автоматизированная измерительная система для исследования магнитных свойств материалов
15.	Автоматизированный вибрационный магнитометр
	Учебно-научная лаборатория сканирующей зондовой микроскопии №24 корпус 3
16.	Сканирующий зондовый микроскоп SOLVER P47
17.	Сканирующий зондовый микроскоп SOLVER Next
	Учебно-научная лаборатория радиоэлектроники и микроэлектроники №25а корпус 3
	Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи с многофункциональным
]	программным обеспечением ZetLab 96
	Лазеры ЛГИ-118-3В, ЛГИ-118-3ВИП; спектрофотометр ИКС-29 (Ломо)
	Измеритель магнитной индукции
	Испытатель транзисторов и диодов Л2-54
	Осциллограф цифровой WA 102 (2)
	Осциллограф цифровой Tektronix TSD 1002B
	Генератор сигналов электрический UTG2025A (3 шт)
	Двухканальный источник питания QJ5003C III (3 шт)
26.	Муфельная печь МИМП-3П
	Лаборатория твердотельной электроники №247 корпус 3

Программно-аппаратный комплекс для микроанализа и морфологического анализа 27. поверхности Nanoeducator
Стенд по исследованию пироэлектрического эффекта динамическим методом в
температурном интервале от 20 до 200 °C, анализа распределения поляризации по
28 толщине сегнетоэлектрических материалов и определения динамических коэффициентов
теплопроводности и температуропроводности
Установка по исследованию петель диэлектрического гистерезиса в температурном
²⁹ -интервале 25 – 550 °C
30. Импульсный анализатор температуропроводности XFA 500LT
31. Генератор функциональный АНР-1250
32. Измеритель иммитанса Е7-20
33. Усилитель высоковольтный 677В-Н-СЕ
Фоточувствительный измеритель «Вектор-175» для исследования диэлектрических
34 спектров в частотном диапазоне 0,1 Γ ц – 30 М Γ ц.
35. Осциллограф цифровой GDS-2102, 2 канала х 100МГ/USB/Good Wi11
36. Осциллограф цифровой ATTEN ADS 1042 CML
37. Осциллограф цифровой ATTEN ADS 1202 CAL
38. Цифровой осциллограф ZET-302
Научно-исследовательская лаборатория кристаллизации ЦКП ТвГУ (5 корп. 5,8
лаб.)
39. Двухканальный цифровой селективный усилитель с цифр. обработкой сигнала
40. Программно-аппаратный комплекс для синтеза образцов оксидных соединений
41. Установка для роста кристаллов Редмет
Учебно-научная лаборатория физики диэлектриков, пьезоэлектриков и
сегнетоэлектриков-полупроводников № 35
To Company to Moment Date and Monthly
Лабораторные установка для изучения мостов переменного тока 42.
Vстановка по изучению работы куметров
42. Установка по изучению работы куметров Установка по наблюдению дислокации в шелочно-голоминых кристациов
42. Установка по изучению работы куметров 43. Установка по наблюдению дислокации в щелочно-голоидных кристаллов Установка по изучению микротверлости, шелочно-голоидных кристаллов
42. Установка по изучению работы куметров 43. Установка по наблюдению дислокации в щелочно-голоидных кристаллов 44. Установка по изучению микротвердости щелочно-голоидных кристаллов 45. Стенд по измерению диздектрических характеристик диздектриков в СВЧ диадазоне
42. Установка по изучению работы куметров 43. Установка по наблюдению дислокации в щелочно-голоидных кристаллов 44. Установка по изучению микротвердости щелочно-голоидных кристаллов
42. Установка по изучению работы куметров 43. Установка по наблюдению дислокации в щелочно-голоидных кристаллов 44. Установка по изучению микротвердости щелочно-голоидных кристаллов 45. Стенд по измерению диэлектрических характеристик диэлектриков в СВЧ диапазоне 46. Установка по изучению пьезоэлектрических свойств кристаллов кварца
42. Установка по изучению работы куметров 43. Установка по наблюдению дислокации в щелочно-голоидных кристаллов 44. Установка по изучению микротвердости щелочно-голоидных кристаллов 45. Стенд по измерению диэлектрических характеристик диэлектриков в СВЧ диапазоне 46. Установка по изучению пьезоэлектрических свойств кристаллов кварца 47. Установка по изучению температурной зависимости электропроводности щелочно-
42. Установка по изучению работы куметров 43. Установка по наблюдению дислокации в щелочно-голоидных кристаллов 44. Установка по изучению микротвердости щелочно-голоидных кристаллов 45. Стенд по измерению диэлектрических характеристик диэлектриков в СВЧ диапазоне 46. Установка по изучению пьезоэлектрических свойств кристаллов кварца 47. Установка по изучению пьезоэлектрических свойств кристаллов кварца 48. Установка по измерению температурной зависимости электропроводности щелочногалоидных кристаллов
42. Установка по изучению работы куметров 43. Установка по наблюдению дислокации в щелочно-голоидных кристаллов 44. Установка по изучению микротвердости щелочно-голоидных кристаллов 45. Стенд по измерению диэлектрических характеристик диэлектриков в СВЧ диапазоне 46. Установка по изучению пьезоэлектрических свойств кристаллов кварца 47. Установка по изучению температурной зависимости электропроводности щелочно-